

# X線による応力測定について

大阪大学工学部 山 田 朝 治

## 1. 緒 言

X線による応力測定は、はじめドイツにおいてその可能性が発表<sup>1)</sup>されて以来、現在までに唯一の非破壊的測定法として多数の研究者により、各種金属材料について基礎、応用両面にわたって研究成果が発表され、測定方法等については、ほとんど完成された観がある。しかし最近の著書<sup>2)</sup>、文献<sup>3)</sup>等を読むまでもなく、この方法を研究室または工場現場等で実際に応用する場合、今なお面倒な問題が解決されていないということは、この測定に従事する人びとの一致した見解であろうと思われる。

面倒なこととは、まず第一に測定精度の問題であり、第二に測定された応力の意義が材料によってはそれほど簡単明りょうでない点にある。測定精度の点に関しては、比較的巾広く、かつ黒化度が必ずしも一様でない回折線の微小移動を測定しなければならないので、たとえば鋼材等において残留応力を測定する場合、比較的鮮鋭な回折線を与える材料であっても、 $\pm 5 \text{ kg/mm}^2$  ていど誤差は認めなければならず、とくに主応力の方向決定の精度については、ほとんど評価されていないようである。

つぎに応力の意義については、普通の巨視的応力の他に相心力や微小応力等がからみあい、とくに塑性変形後の残留応力についてはこれらの吟味が必要であるが、問題は複雑であり、かつ測定精度が十分でないので明確な説明を与えることは容易ではない。

そもそもX線応力測定法が、一方で連続、均質かつ等方性の材料を仮定している弾性論に基づきながら、他方では不連続で異方性をもつ結晶粒の集合体の中から、ある特定方位の結晶粒をえらんで測定しなければならないという矛盾が、測定結果の中にあらわれてくるわけである。このように、抵抗線ひずみ計等とは異なり、被測定材料そのものの結晶学的性質を直接利用するためには、単に巨視的弾性ひずみのみでなく、むしろ他の結晶学的情報量の方が多い場合が普通であって、これらが回折線の巾を広げたりして応力測定の目的に対する著しい難音となってくるのである。したがって抵抗線ひずみ計等の場合は、測定器そのものの詳しい知識をもたなくて

も、単に使用法さえよく理解すれば、一般技術者がすぐに応用できるものであるが、X線の場合は残念ながら現在のところ、金属結晶学およびX線回折に関するあるいはどの知識がなければ、この測定法に対して誤った価値判断をする恐れが多分に考えられるようである。

X線応力測定法については、X線結晶学に関するほとんどの著書が、その一部をさいて説明しているので、ここでは、最近の文献や著者の経験等から考えて、とくに留意すべき点について述べてみたい。

## 2. 測 定 原 理

この測定法の特徴を理解するために、まず測定原理から説明する。

X線回折に寄与する表面層の厚さは、たとえば鉄の場合ではあとで述べるように、たかだか  $10\mu$  ていどを考えれば十分であるから、図1に示すように主応力  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ ,

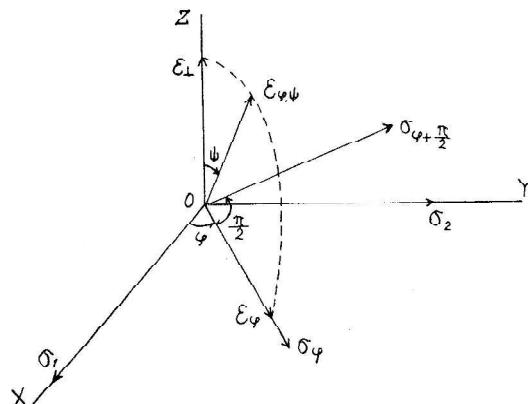


図1 試料表面における応力とひずみとの関係

を試料表面内で考え、 $\sigma_3$ を無視する。いまヤング率をE、ポアソン比をνとすると、任意の方向の応力  $\sigma_\varphi$ 、ひずみ  $\epsilon_\varphi$ についてつぎの(1), (2)式が得られる。

$$\left. \begin{aligned} \sigma_\varphi &= \frac{1}{E} \left( \sigma_\varphi - \nu \sigma_{\varphi + \frac{\pi}{2}} \right) \\ \epsilon_\perp &= -\frac{\nu}{E} \left( \sigma_\varphi + \sigma_{\varphi + \frac{\pi}{2}} \right) \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

$$\epsilon_{\varphi, \psi} = \epsilon_\varphi \sin^2 \psi + \epsilon_\perp \cos^2 \psi \quad (2)$$

ここで、 $\epsilon_\perp$ は試料表面に垂直な方向のひずみ、 $\epsilon_{\varphi, \psi}$

は  $Z-0-\sigma_\phi$  面内にあるひずみである。さらに(2)式を変形して(1)式を代入すると、つぎの応力測定基礎式が得られる。

$$\varepsilon_{\varphi,\psi} - \varepsilon_{\perp} = \frac{(1+\nu)}{E} \sigma_\phi \sin^2 \psi \quad (3)$$

すなわち  $\sigma_\phi$  を求めるためには、 $\varepsilon_{\varphi,\psi}$  および  $\varepsilon_{\perp}$  を測定すればよい。また  $\varepsilon_{\perp}$  の代りに  $\psi$  を順次変えて  $\varepsilon_{\varphi,\psi_1}$ 、 $\varepsilon_{\varphi,\psi_2}$  等の任意の二方向のひずみを測定しても  $\sigma_\phi$  は求められる。

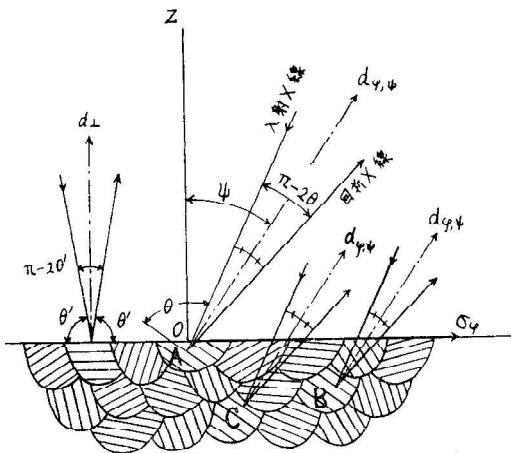


図 2  $Z-0-\sigma_\phi$  面内における格子面間隔の測定原理

これらのひずみをX線回折によって求めるのであるが、図2にその測定原理を示している。ある特定のX線入射方向に対して、多数の結晶粒の中からプラグの反射条件を満足する方位をもつ結晶粒がえらびだされて回折にあずかる。無応力状態の結晶の格子面間隔を  $d_0$  とするとき、 $\varepsilon_{\varphi,\psi}$ 、 $\varepsilon_{\perp}$  はそれぞれ  $(d_{\varphi,\psi} - d_0)/d_0$ 、 $(d_{\perp} - d_0)/d_0$  であらわされるから、応力による  $d$  の変化は小さいと考えて

$$\varepsilon_{\varphi,\psi} - \varepsilon_{\perp} = \frac{d_{\varphi,\psi} - d_{\perp}}{d_0} = \frac{d_{\varphi,\psi} - d_0}{d_{\perp}} = \frac{\Delta d_{\varphi,\psi}}{d_{\perp}} \quad (4)$$

とあらわすことができる。一方プラグの反射条件から

$$\frac{\Delta d}{d} = -\cot\theta \Delta\theta \quad (5)$$

の関係式がみちびかれる。 $\theta$  はいわゆるプラグ角である。したがって(3)、(4)、(5)式より

$$\Delta\theta_{\varphi,\psi} = -\frac{(1+\nu)}{E} \sigma_\phi \tan\theta \sin^2 \psi \quad (6)$$

となる。ここに  $\Delta\theta_{\varphi,\psi}$  は図2で説明すれば、 $(\theta - \theta')$  の意味である。(6)式からわかるように、 $\psi$  を順次変えて  $\Delta\theta$  を測定し  $\sin^2 \psi$  を横軸に、 $\Delta\theta$  を縦軸にとると直線関係が得られるはずであり、その勾配から  $\sigma_\phi$  が求められる。 $\tan\theta$  は厳密に測定する必要はなく、 $E$  または  $\nu$  と同じいどの有効数字で十分であり、一定と考えてよ

い。もちろんX線の波長や格子面が変われば大きく変化するが、この値が大なるほど測定感度が高いから、 $\theta$  の大きい回折線が得られるようなX線をえらぶわけである。

実験技術上の点からいえば  $\pi/4$  ぐらいまであり、0～ $\pi/4$  の間で4点ぐらいをとるのが普通である。すなわち多数のデータから弾性論に従うような応力値を見出す方法であり、多重露出法<sup>4)</sup> または  $\sin^2 \psi$  法<sup>5)</sup> とよばれている。また  $\Delta\theta$  のみを測定して  $\sigma_\phi$  が求められるから、残留応力測定等の場合にも非破壊的に測定できるわけである。

### 3. 試料表面の問題

以上の測定原理からもわかるように、試料を順次傾けて回折線の相対的な微小移動を測定するわけであるが、試料と検出器（フィルムまたは計数管等）との距離が変ると誤差の原因になるため、適当な標準試料をうすぐ試料面に塗布して、この両者の回折線の距離を測定するのが普通である。いずれにしても鮮鋭で、かつ一様な強度分布をもつ回折線が得られないと測定が困難になってくる。測定試料そのものにゲージの役目をさせるわけであるから、いかに非破壊検査といえども表面が黒皮のままで論外である。したがってX線的応力測定法を行なう場合、できる限りこの測定に適した表面状態にしなければならない。このことは多くの研究者によって指摘されているが、この表面処理は最も重要な測定技術の一つといるべきである。

いま鉄を例にとって回折にあずかるX線の侵入深さについて考えてみる。これは吸収係数から見積ることができるが、鉄の応力測定には  $C_r K_a$  による(310)面および  $C_r K_a$  による(211)面からの回折線がよく使用されるので、これらのX線についての計算例<sup>6)</sup>を図3に示している。縦軸は回折線の強度を1としたとき、 $t$ なる厚

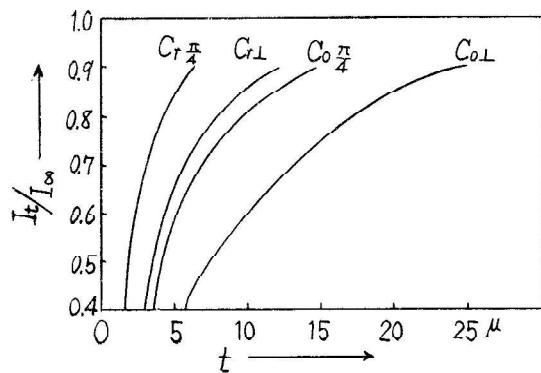


図 3 回折線に寄与する表面厚さ  
(鉄の場合)

までの有効強度を示している。当然のことながら、X線の垂直入射のときと斜入射のときとでは、大きな相違がみられることは注意を要する問題である。 $CrK\alpha$ の場合の有効厚さは、垂直入射のときでも  $10\mu$  ぐらいを考えればよく、 $45^\circ$  の斜入射ならば  $5\mu$  ぐらいで十分である。

したがって測定面は凹凸の少ない ( $1\mu$  以下) 相当良好な仕上面であり、かつ仕上げ加工による格子ひずみを生じさせない注意が必要である。このために電解研磨が適当であるとした報告例が多いが、化学腐食または化学研磨法も利用されている。もっとも、粒界近傍が腐食されやすい材料では腐食法も注意を要する。これは数  $\mu$  の厚さといえば、材料によっては平均の結晶粒の大きさより小さい、すなわちX線回折にあたる表面層は、ほとんど one grain 層と考えなければならないからである。たとえば図2では、B, Cの結晶粒はもはや回折に寄与しないと考えるべきである。また除去すべき表面加工層は、材料によってまちまちであり、筆者の経験によれば、比較的近接した領域においても加工層の厚さが異なるという場合もあり、もし鮮鋭な回折線が得られないときは、非破壊検査として許される範囲内で表面層を取り除く努力はしなければならないであろう。しかし、適当に表面処理をしても、とくに残留応力測定の必要性が多いと思われる熱処理したものや、冷間加工した材料に適当な回折線の得られないものが多く、そのためにX線測定法の応用性がせげめられているのが現実のようである。

#### 4. 連続測定法について

一般にX線応力測定法にとって最も困難な問題は、前節で述べたように良好な回折線が得られない場合が多いということであるが、測定技術の点に関しても原理は簡単でありますながら、応力による回折線の位置の変化は僅かであるために、かなりの習熟を必要とするようである。また測定値のばらつきも多いが、弾性論による規則性を利用する  $\sin^2\psi$  法等によって、少しでも測定精度をためようとしているわけである。この多数のデータから応力を求めようとする考えは非常に重要であり、たとえ測定時間が長くなても、X線以外に非破壊的測定法のないことを考えると、当然はらうべき努力であろう。

つぎに筆者は、主応力の方向決定の精度をためるとともに、測定技術上いろいろの利点を含むX線斜入射のままの連続測定法<sup>7)</sup>について述べてみたい。図4は、図1, 2における  $\psi$  なる角をもつ斜入射の場合を示しているが、 $\sin^2\psi$  法と異なる点は斜入射のまま、すなわち  $\psi$  を一定にして  $\phi$  のみを変化させるのである。図4に示し

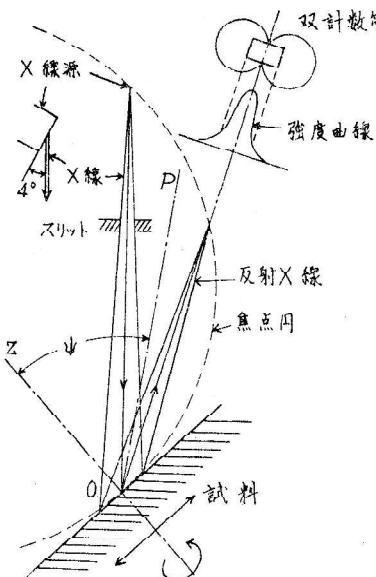


図4 双計数管による連続測定法の原理

ているように、O-Z軸のまわりに試料かまたは装置を回転させるのである。この測定法の説明の前に図4における双計数管と焦点円について述べておく。双計数管は回折線の微小移動の測定精度をあげるために、筆者の研究室で試作研究してきた<sup>8)</sup>が、この原理はうすい隔壁で接する二個のG-M計数管に、隔壁で二分されるように回折線を入射し、二個の計数管の出力の差をとると、回折線がどちらか一方へ移動すれば出力の差が増大するから、回折線の相対的移動量を直読できるわけである。この測定法については、小島ら<sup>9)</sup>の研究によって実用的な装置にまで発展させられているが、ここに述べる連続測定法は、必ずしも双計数管法に限ることではなく、ただ回折線の微小移動を直読できるから有利であり、連続記録させれば個人誤差の入る余地は少なくなるであろう。つぎに図4ではブラッグ角  $\theta$  の測定に、いわゆる集中法を利用しX線源を第一スリットに兼用している。この方法は測定面とX線源および検出器の位置が、同一円（焦点円）上にあれば、発散するX線を照射してもよく、したがって回折線の強度が増大する利点のほかに、測定面におけるX線照射面積を大きくとるので、結晶粒が比較的大であっても一様な強度分布をもつ回折線が得られやすいのである。結晶粒粗大のために、なおかつ一様な強度分布が得られないときは、図の矢印で示すように測定面内で平行移動して測定し平均をとる。もちろん、それらの領域において応力分布は変化しないと仮定したことである。

さて本論にもどるが、いま  $\phi$  を  $\phi_1$ ,  $\phi_2$  と変えてそれぞれの方向に相当するひずみの差をとつてみると、(3), (4)式から計算してつぎのようになる。

$$\sigma_{\phi_1} - \sigma_{\phi_2} = \frac{d_{\phi_1, \psi} - d_{\phi_2, \psi}}{d} \cdot \frac{E}{1+\nu} \cdot \frac{1}{\sin^2\psi} \quad (7)$$

したがって連続測定により O-P 方向の格子面間隔の最大と最小、すなわち  $(d_{\phi_1, \psi} - d_{\phi_2, \psi})$  が最大になるような  $\phi_1$ ,  $\phi_2$  を求めれば、それが主応力方向と一致するだけで、図1においては 0 と  $\frac{\pi}{2}$  になる筈であり、実験に

よって直接主応力方向が決定できる。さらに  $\sigma_2$  が無視でき、かつ引張りまたは圧縮のいずれかが予測されるときには、(7)式のみで主応力が決定されるが、このことはかなり重要な意味をもってくる。すなわちX線の試料面に対する入射角  $\psi$  は、常に一定であるため、照射面積およびX線の有効侵入深さはともに一定であり、また集中法を採用しても焦点円は一定であり、入射角  $\psi$  を変えるために生ずる焦点円変化による誤差を考える必要はない。

さらに重要なことは、照射面積およびX線の侵入深さが変われば、回折線の強度曲線の形を変化させる可能性があることであり、一層  $\psi$  一定の測定方法が望ましく、実用的な装置としても技術的にとくに困難な点はないと思われる。もし  $\sigma_2$  が無視できない場合でも、主応力の差と方向が実験的に決定できるわけであり、 $\sin^2 \psi$  法と併用すれば測定精度を一層たかめることができると期待される。

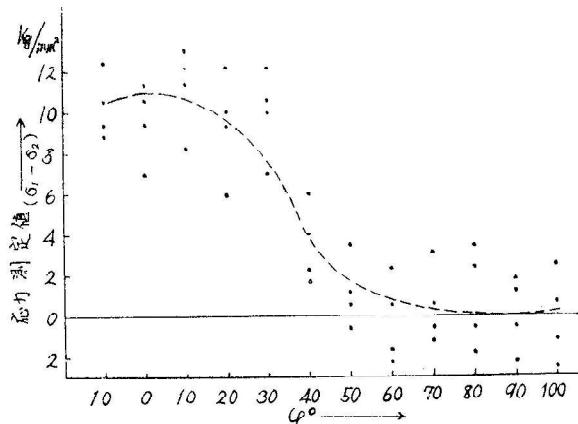


図 5 図 4 の原理による応力測定の一例

X線:  $C_r, K_\alpha$   
 試料: 軟鋼 (0.2% C), (310) 面,  
 平均結晶粒の大きさ  $50\sim60\mu$   
 照射面積:  $8\times8\text{mm}^2$ ,  $\psi=45^\circ$

図 5 は軟鋼に曲げ変形を与えておいて、入射角  $\psi$  を  $45^\circ$  にしたまま、 $\phi$  を  $10^\circ$  ごとに変えてゆき、図 4 に示す原理で測定したものである。結晶粒が比較的粗大のため、回折線の強度が一様でなく、各  $\phi$  に対してそれぞれ測定面に平行に試料を少し摺動させたときのデータのばらつきも示してある。また図 6 は、同じ連続測定法において双計数管の出力（回折線の位置に相当）を、試料の回転すなわち  $\phi$  の変化に応じて連続記録させたもので、曲げ塑性変形後の軟鋼の表面の残留応力測定例である。X線は  $C_r, K_\alpha$ 、回折線の半価巾は約  $1^\circ$  であり、入射角

を  $45^\circ$  にしたまま連続測定を行い、 $\phi$ とともにその出力の変化をみると、明らかに周期性が認められ、AB 間が主応力差  $5\text{kg/mm}^2$  に相当している。

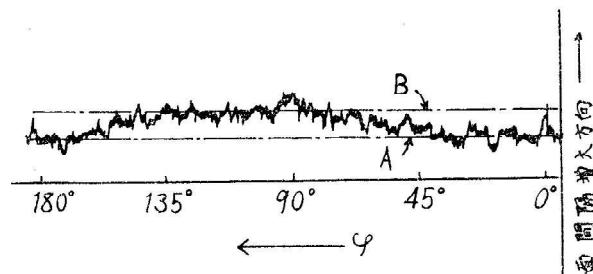


図 6 連続測定による残留応力測定例

## 5. 結 言

X線応力測定に対する筆者の考えを簡単に述べてきたが、一般技術者としては精度が悪くても非破壊測定として唯一の方法であることを考え、測定技術の向上につとめるべきであろう。

また測定技術としては、それほど新しくないにもかかわらず、いまだに信頼できる規格、たとえば J I S 規格のようなものができないのが現状である。主としてこの研究に従事するものにとって、材料の組織または回折線の状態から、その具体的な測定法およびそれによる測定誤差をあらかじめ見積ることのできるような信頼できる規格または便覧などを作製する責務があると思うがどうであろうか。

## 文 献

- 1) G. Sachs and J. Weents : Z. f. Phys., **64**, 344 (1930)
- 2) 仁田 勇鑑修 : X線結晶学, p. 362~376 (1959)
- 3) R. I. Garrod and G. A. Hawkes : Brit. J. Appl. Phys., **14**, 422 (1963)
- 4) G. A. Hawkes : Brit. J. Appl. Phys., **8**, 229 (1957)
- 5) E. Macherauch : Proc. 3rd Inter. Conf. Non-destruct. Test., 720 (1960)
- 6) 石井勇五郎 : X線による応力測定 p. 10 (1959) 運輸技研
- 7) T. Yamada and Y. Soezima : Tech. Repts. Osaka Univ., **11**, 91 (1961)
- 8) 田中, 那須, 山田 : 応用物理, **22**, 317 (1953)  
 S. Tanaka, T. Nasu and T. Yamada : Tech. Repts. Osaka Univ., **5**, 245 (1955)
- 9) 小島, 田丸ほか : Proc. 3rd Inter. Conf. Non-destruct. Test., 737 (1960)  
 小島, 田丸 : 材料試験, **11**, 637, (1962)